

Offline-Inspection Equipment Series
MICRO ACE シリーズ



- 分解能1 μ ～超高分解能検査が可能
- 焦点深度が広く欠点の全形撮像が可能、ピントによるバラツキなし
- 豊富な光学系(透過、反射、暗視野など)の組み合わせと、画像処理による欠点種弁別が可能
- 高精度ステージを採用し、レーザー顕微鏡(オプション)の3D計測による欠点解析が可能
- ディスプレイ、電子材料、電池向けなど先端素材の研究開発シーンでも活躍

3D計測による欠点解析

3D計測機との連動が可能のため、検査MAPからボタン1つで欠陥の深さを測定可能

>>> 製品開発時などに

超高分解能検査

1m²内にある、1～4 μ mの欠陥数を把握でき、工程の評価が可能

>>> 工程改善時などに

欠点種弁別可能

鮮明な画像で、埃と欠陥の区別、欠陥の種類の区別が可能

>>> 最終工程時などに



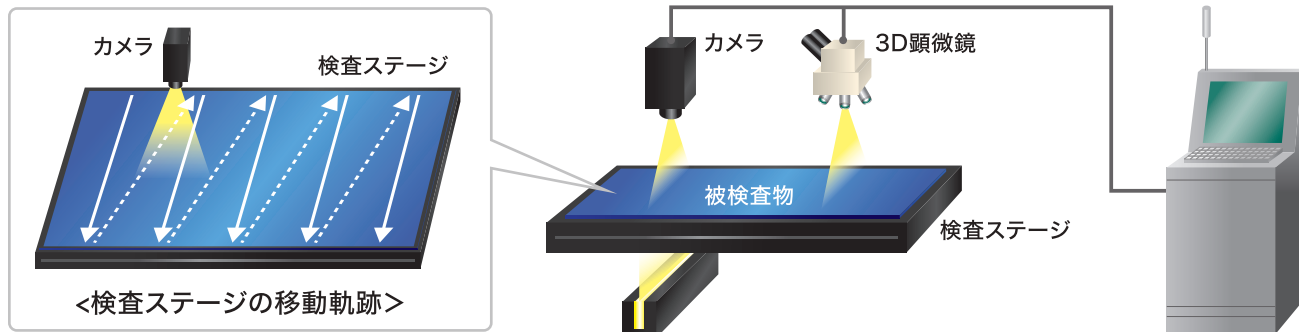
- 分解能2.8 μ ～10 μ での検査に適している
- 人による顕微鏡検査の自動化、定量化に最適
- フィルムやガラスの μ mレベルの凹凸欠点、偏光輝点、キズの検出が可能



検査ステージ



検査画面



■ 分解能 1～4 μm

高精度専用レンズ (BASSOON) により鮮明な画像で表示



2 μm (透過)
BASSOONレンズ

2 μm (反射)
BASSOONレンズ

3 μm (透過)
産業レンズ

顕微鏡

■ 3Dの顕微鏡との連動

深さ・高さを測定



■ 高精度の検査ステージ

検査ステージに石定盤を採用することで、温度変化による測定誤差を最小限に。また、土台のサスペンションにより免震性にも優れている。



■ 専用セットステージ



フィルムを手早く、きれいに貼ることができるセットステージ

高精度オフライン検査装置

OMI-FE

10～100 μ で簡易検査



- 分解能10 μ からの簡易検査が可能
- A4サイズを約10秒で測定
- 検査結果マップを等倍で印刷し、マップと欠陥サンプルを直接比較可能

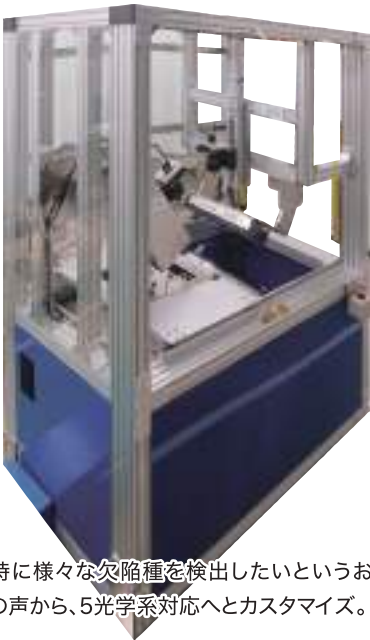


検査画面

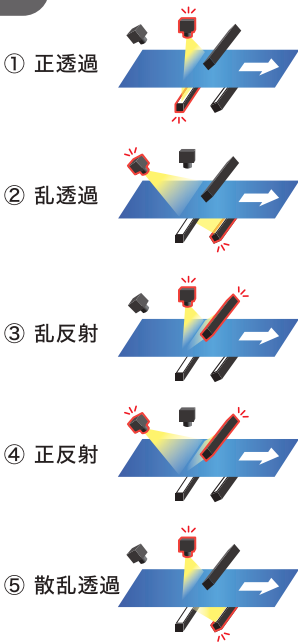
ベースモデルをカスタマイズし、お客様仕様に！

MICRO ACEシリーズのカスタマイズ実績を一部ご紹介いたします。
ご質問・ご要望等は、弊社までお気軽にご相談ください。

OMI-FE ▶ 5光学系対応に



同時に様々な欠陥種を検出したいというお客様の声から、5光学系対応へとカスタマイズ。



光学系による欠点検出表					
	コート 抜け	キ ズ	凹 凸	フィ ッシュ ユア イ	異 物
① 正透過	△	×	×	○	◎
② 乱透過	×	△	○	◎	△
③ 乱反射	○	△	△	△	○
④ 正反射	○	△	△	○	○
⑤ 散乱透過	△	○	×	×	○

OMI-FE ▶ 検査サイズを拡大



通常A4サイズの検査
サイズを拡大したいと
いうご要望から、検査
ステージを設けました。

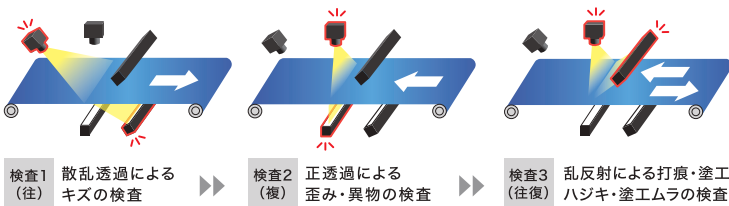
ODM-W ▶ 巻き返し機型に



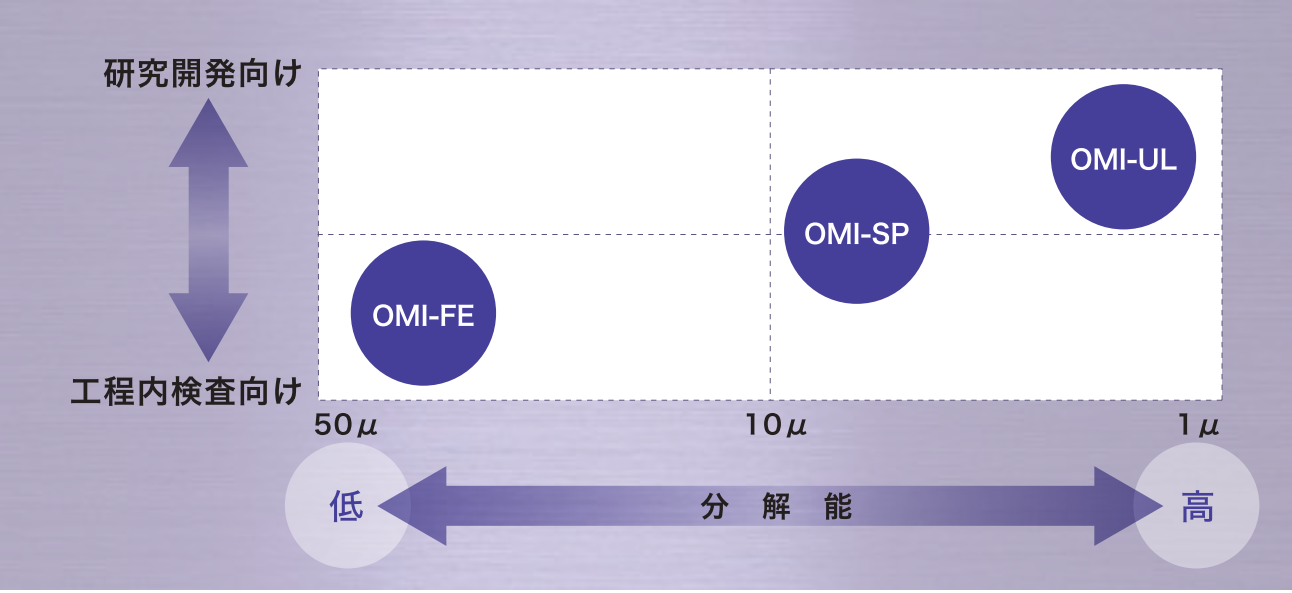
長い周期欠点にも対応が
できるよう、置き型を巻き
返し型にカスタマイズ。

ODM-T ▶ 微小・低コントラスト欠陥に

インラインでは難しい、微小・低コントラスト欠点の検出と、抜き取り
評価として、キズや押し痕など、周期欠点の検出を可能に。



■POSITIONING MAP



■SPECIFICATION

型 式	OMI-UL	OMI-SP	OMI-FE
カメラ	16000bit	16000bit	2048・4092・6144・8192bit
レンズ	自社製特殊レンズ	産業用高精度レンズ	市販標準レンズ
光 源	特殊LED	LEDライン照明	
分 解 能	1～4μm	2.8～10μm	10～100μm
検査サイズ	A4/A3		A4
測定時間	A4:10分	A4:5分	A4:10秒
検査ステージ	高精度ステージ(石定盤)	標準ステージ	卓上ステージ (540×720×600mm)
オプション	3D顕微鏡		ステージ一体型

OMI-UL、OMI-SPを使った受託検査を承っております。研究目的や出荷前の評価テストなど、詳しくは滋賀本社までお問い合わせください。

